

傾斜回転式プラズマ強化化学蒸着（Pecvd）チューブ炉装置

商品番号: KT-PED



前書き

KINTEKのPECVDコーティング装置は、LED、太陽電池、MEMS向けに低温で高精度な薄膜を実現します。カスタマイズ可能な高性能ソリューションです。

[詳細を学ぶ](#)

サンプルホルダー	サイズ	1～6インチ
サンプルホルダー	回転速度	0～20rpm 調整可能
サンプルホルダー	加熱温度	≤800℃
サンプルホルダー	制御精度	±0.5℃ SHIMADEN PIDコントローラー
ガスパージ	流量計	マスフローメーターコントローラー（MFC）
ガスパージ	チャンネル数	4チャンネル
ガスパージ	冷却方式	循環水冷却
真空チャンバー	チャンバーサイズ	Φ500mm X 550mm
真空チャンバー	観察窓	バッフル付き全視野ポート
真空チャンバー	チャンバー材質	316ステンレス鋼
真空チャンバー	ドアタイプ	前面開閉式ドア
真空チャンバー	キャップ材質	304ステンレス鋼
真空チャンバー	真空ポンプポート	CF200フランジ
真空チャンバー	ガス導入ポート	φ6 VCRコネクター
プラズマ電源	電源	DC電源またはRF電源
プラズマ電源	結合方式	誘導結合またはプレート容量結合
プラズマ電源	出力電力	500W～1000W
プラズマ電源	バイアス電源	500V
真空ポンプ	前級ポンプ	15L/S ベーンポンプ
真空ポンプ	ターボポンプポート	CF150/CF200 620L/S-1600L/S
真空ポンプ	リリーフポート	KF25
真空ポンプ	ポンプ速度	ベーンポンプ：15L/s、ターボポンプ：1200L/s または 1600L/s
真空ポンプ	真空度	≤5×10 ⁻⁵ Pa

真空ポンプ	真空センサー	イオン化/抵抗真空計/薄膜真空計
システム	電源供給	AC 220V /380 50Hz
システム	定格電力	5kW
システム	外形寸法	900mm X 820mm X 870mm
システム	重量	200kg